

第六回

集積化 MEMS 技術研究ワークショップ

研究奨励賞

高安 基大殿

MEMS 慣性センサを用いた
移動体制御の検討

(社) 応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会
第六回研究ワークショップにおいて発表され
た貴台の研究発表は、審査の結果、ポスター賞
に値するものと認め、ここに表彰します。

平成 28 年 3 月 19 日

(社) 応用物理学会

集積化 MEMS 技術研究会運営委員会

委員長 有本 和民

